

はんだペースト リフローでのボイド抑制

—はんだバンプ形成用ファインピッチ対応—

実装技術

高橋 政典

概要

はんだ中のボイドは疲労寿命の低下を招くことから、発生を極力抑えたい。とりわけ ファイン(Fine Pitch)パターンでは、数十 μm 程度のボイドでも信頼性に影響を与える可能性がある。本報では、120 μPitch の試験基板を用いて「パッド表面処理」「リフロー温度」を中心にボイド抑制について検討した結果を報告する。

報告内容

01

試験基板

02

試験結果

1) はんだペースト種と温度プロファイル

2) パッド表面処理 (Cuフリフラックス, NiAu, Sn)

03

考察とまとめ

1. 試験基板

試験基板I

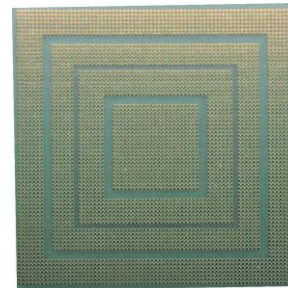
試験基板仕様

パッケージ基板のインナーバンプを模擬

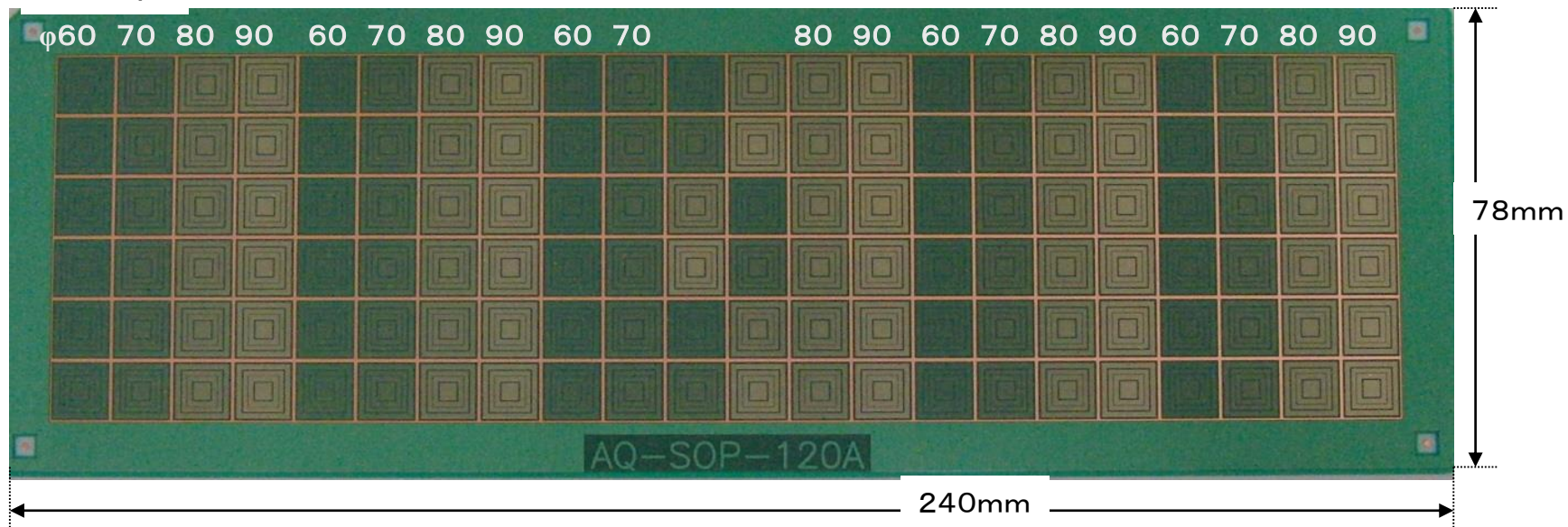
・パッド径: 60, 70, 80, 90 μ m (下記参照)

・パッドピッチ: 120 μ m ・板厚: 0.30mm

ピース拡大

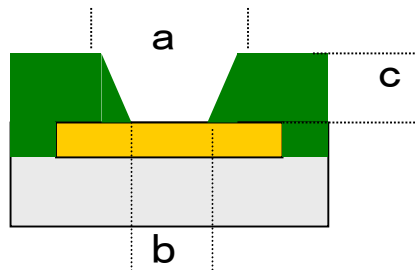
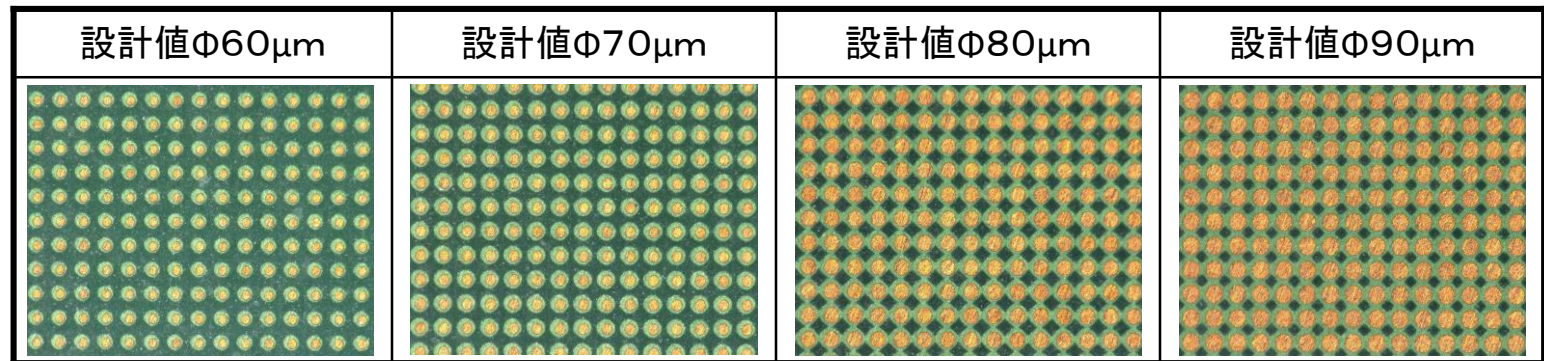


パッド径



試験基板II

各パッドの外観と実測寸法



	設計値 $\phi 60\mu\text{m}$	$\phi 70\mu\text{m}$	$\phi 80\mu\text{m}$	$\phi 90\mu\text{m}$
a	53.0	62.5	83.5	94.0
b	44.0	53.0	77.0	87.5
c	14.5	17.0	19.0	18.0

(μm)

リフロー後のはんだバンプ高さ

* メタルマスク厚: 30 μ m

ランド径 マスク開口	穴径 60 μ m	70 μ m	80 μ m	90 μ m
穴径 60 μ m	15.3	11.2	4.5	2.7
70 μ m	20.8	22.3	11.3	9.2
80 μ m	33.8	27.8	19.8	15.3
90 μ m	43.7	40.7	26.7	24.7

単位(μ m)

2. 試験結果

1) ソルダーペーストと温度プロファイル

2) パッド表面処理

試験方法

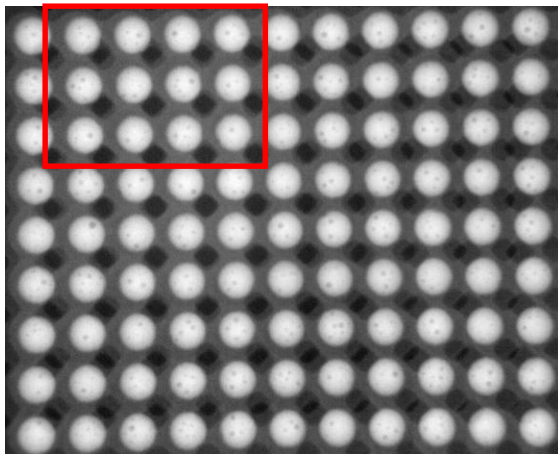
試験方法

OSP処理基板に solderペースト印刷 → リフロー → 洗浄 → 評価

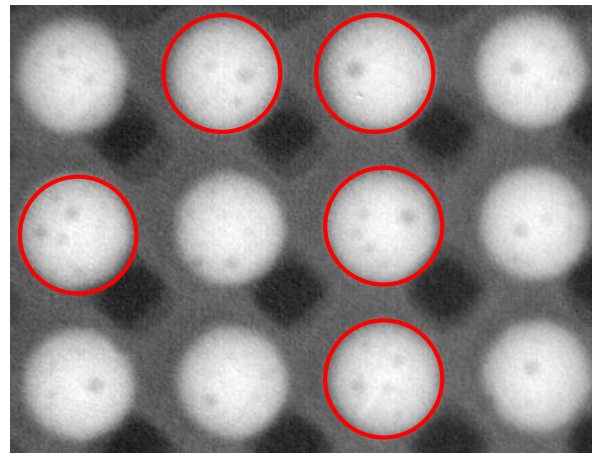
ボイド率

特定箇所をX線観察 → ボイドが多く見える箇所を選定(3×4列) → ボイドが多く見えるランドを選定(5パッド) → ボイド度率算出

・ボイド率 (ボイド面積 / パッド面積) × 100



選定箇所(3×4列)



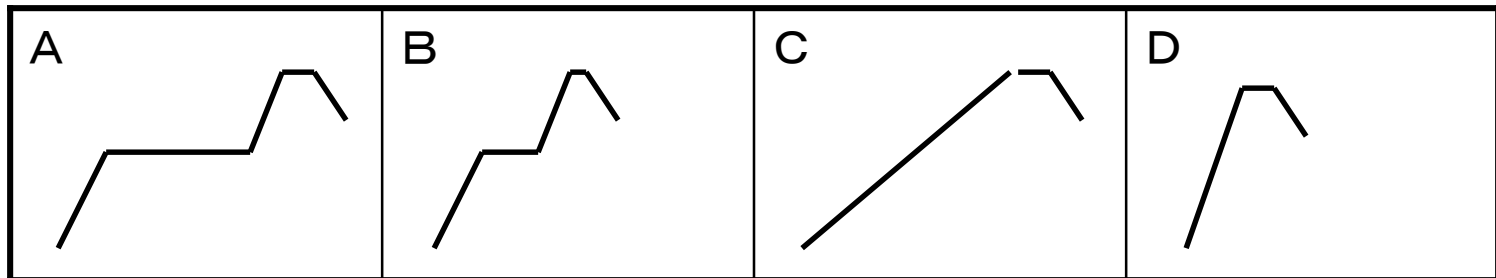
選定パッド(5パッド)

ソルダーペーストと温度プロファイル

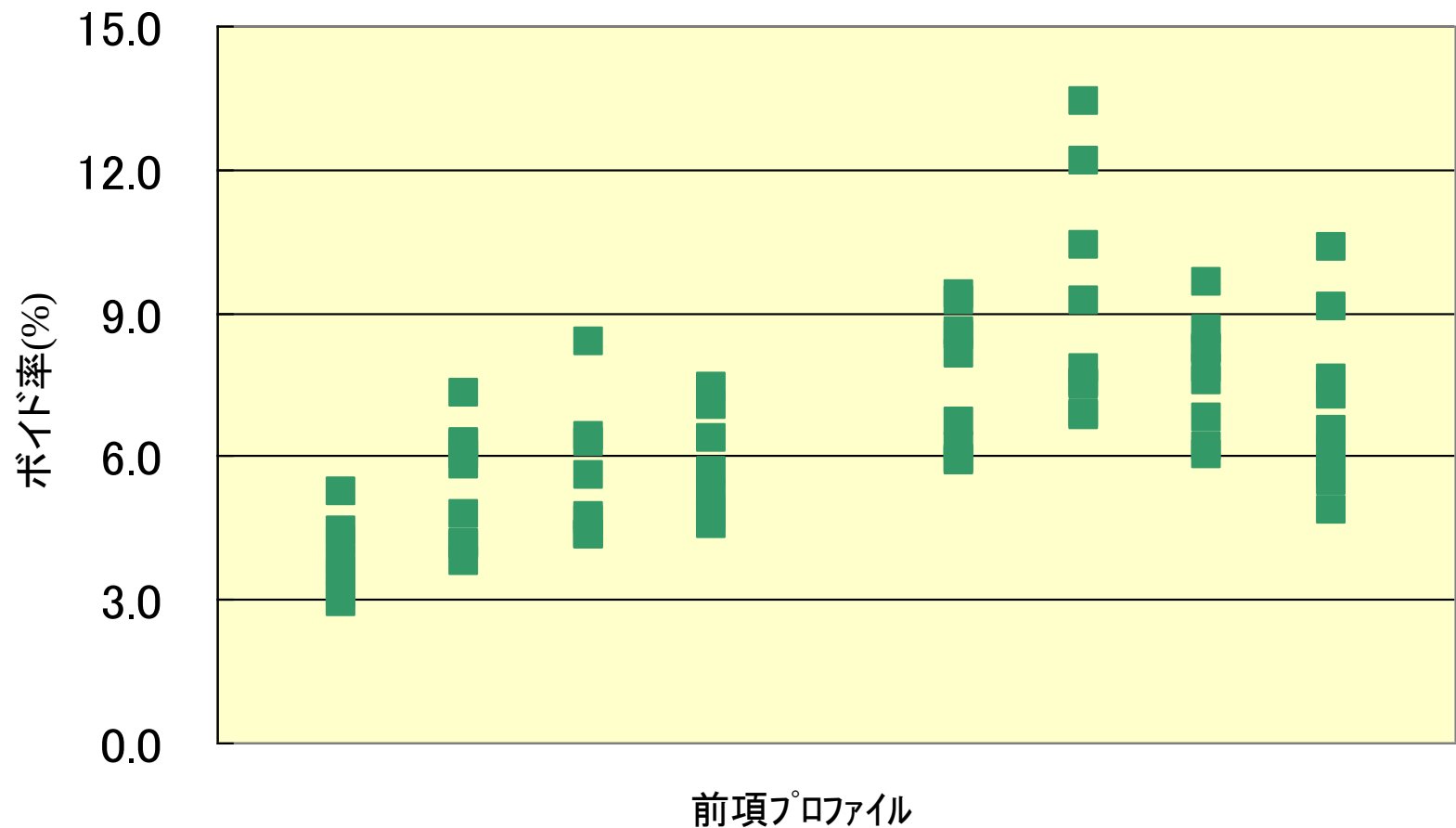
ソルダーペースト仕様

	金属組成	粒径 (μm)	粘度 ($\text{Pa}\cdot\text{s}$)	フラックス含有量 (%)	Cl含有量 (%)
A type	Sn-3.0Ag-0.5Cu	1~10	260	11.5	0
B type	Sn-3.0Ag-0.5Cu	1~10	210	11.4	0.05

リフロー温度プロファイル



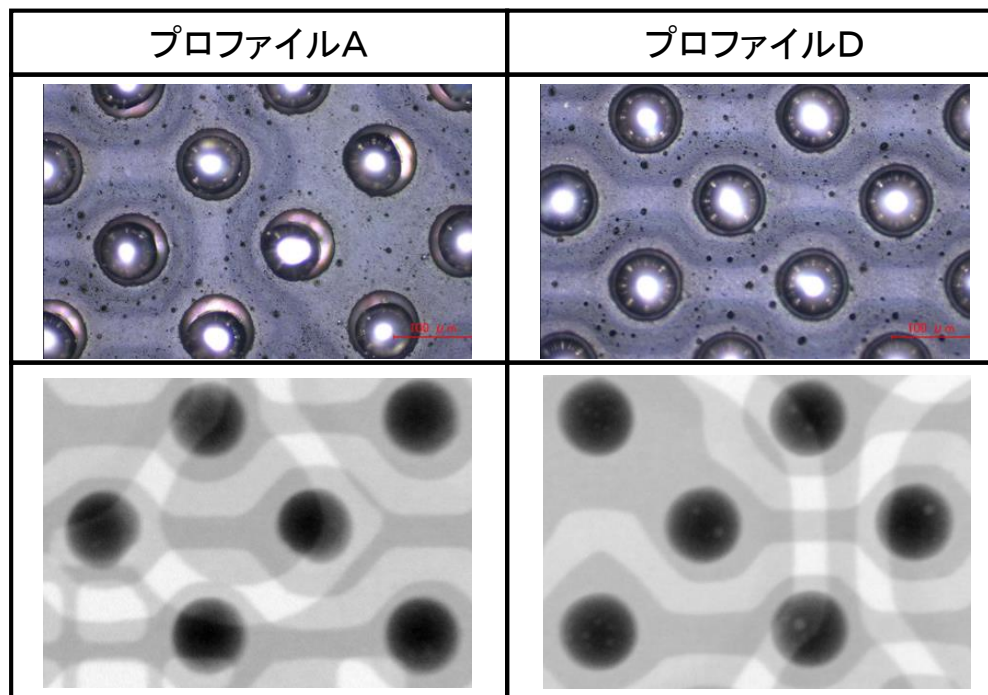
ボイド率(ソルダーペーストA)



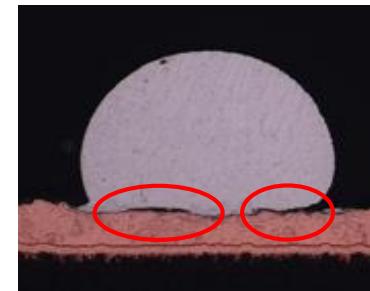
はんだ付け性とボイド(ソルダーペーストB)

外観とボイド

外観写真とボイドのX線線写真



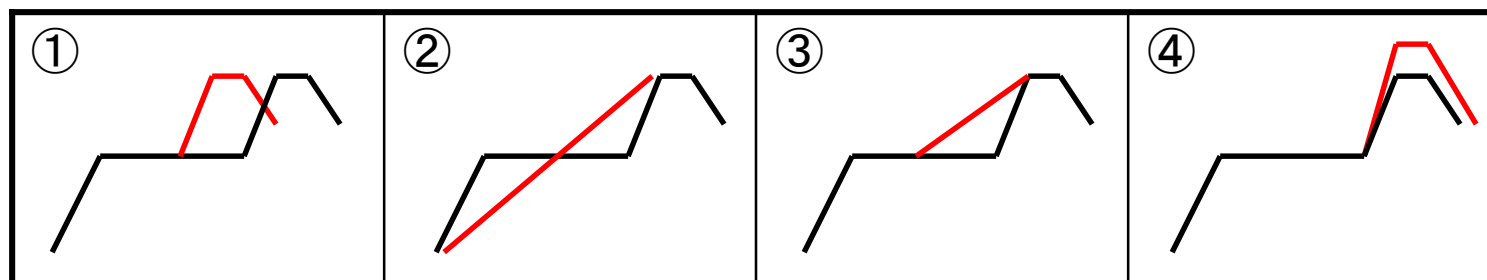
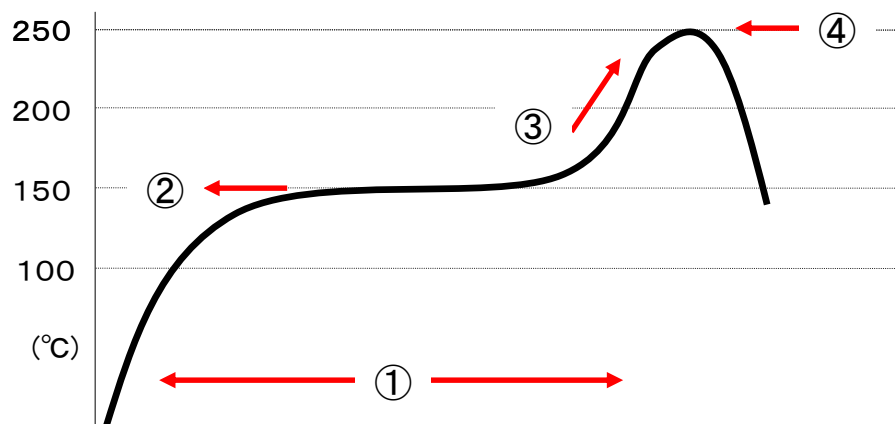
参考)プロファイルA断面写真



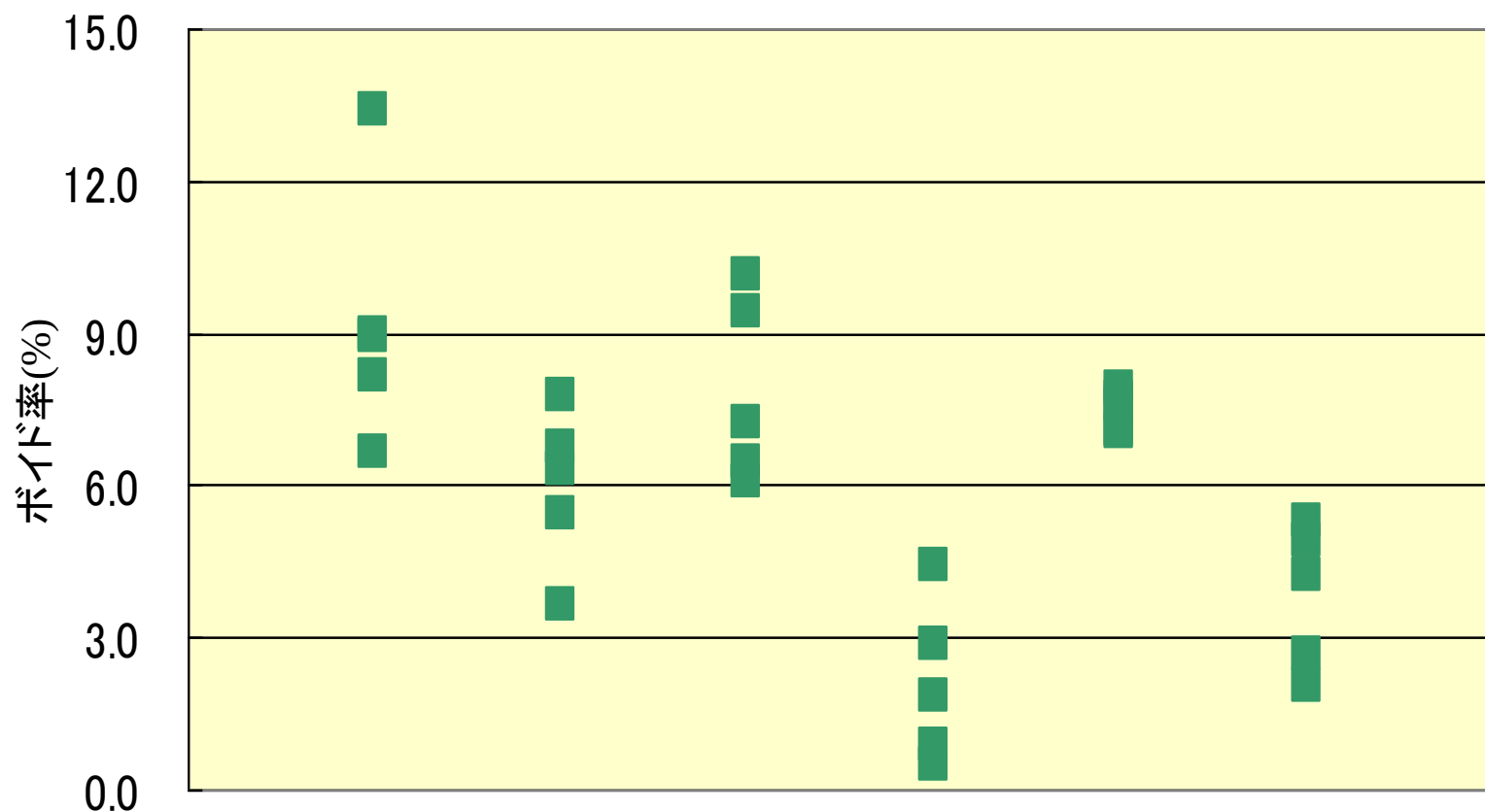
リフロー温度プロファイル

リフロー温度プロファイルの考え方

- ①はんだ溶融までの熱劣化。
- ②プリヒート有無(温度)
- ③はんだ溶融時の昇温速度
- ④最高温度



ボイド率(ソルダーペーストB)



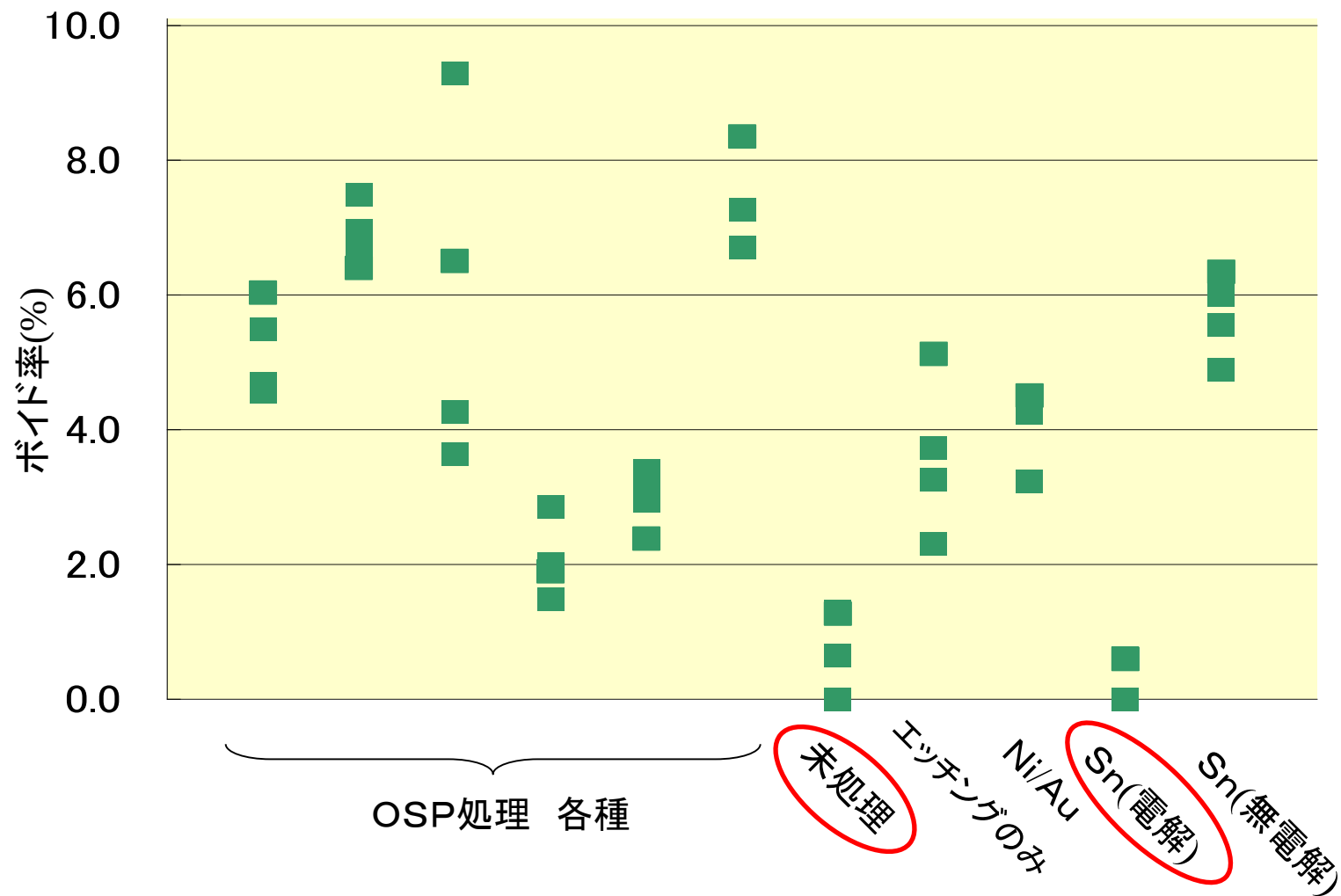
—前項①~④の考えで作成した各種リフロー温度プロファイル—

パッド表面処理の検討

パッド表面	方式	処理条件		
		エッチング液	OSP種	OSP処理条件
Cu	未処理	—	—	—
	エッチングのみ	・硫酸-過酸化水素系 ・硫酸-過硫酸Na系	— —	— —
	OSP処理	・硫酸-過酸化水素系 ・硫酸-過硫酸Na系	・2種	①塗布方法 ・ライン処理(微小パッド対応) ・スプレー ・はけ塗り ②塗布条件 ・ライン速度 ・塗布時間
Ni/Au	無電解めっき	前処理* → プレディップ° → アクチベータ → 無電解Ni(5 μ m) → 無電解Au(0.05 μ m)		
Sn	無電解めっき	前処理* → プレディップ° → 無電解Sn(1 μ m)		
	電解めっき	前処理* → プレディップ° → 電解Sn(4 μ m) → ホストディップ°		

*) 前処理 : 脱脂 → ソフトエッチング → 酸処理

パッド表面処理とボイド率

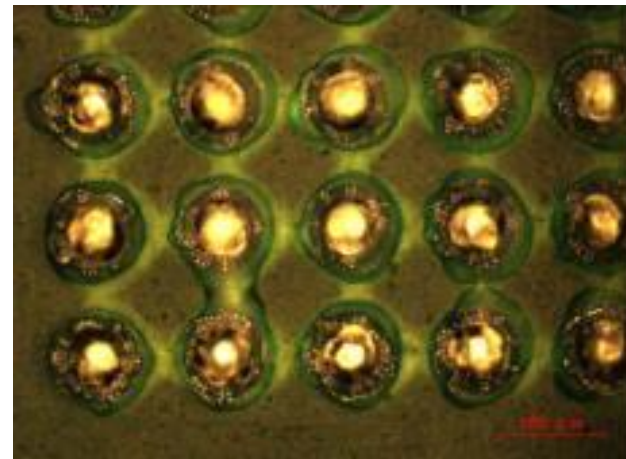
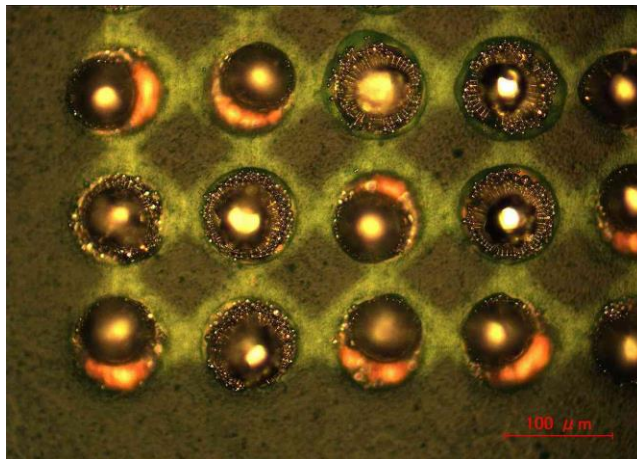


未処理基板でのボール落ち

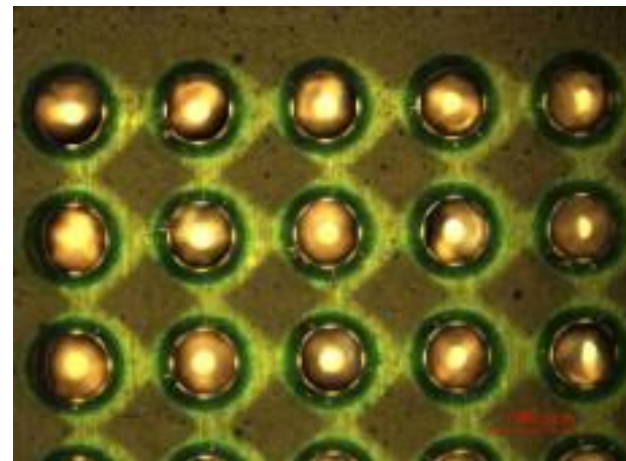
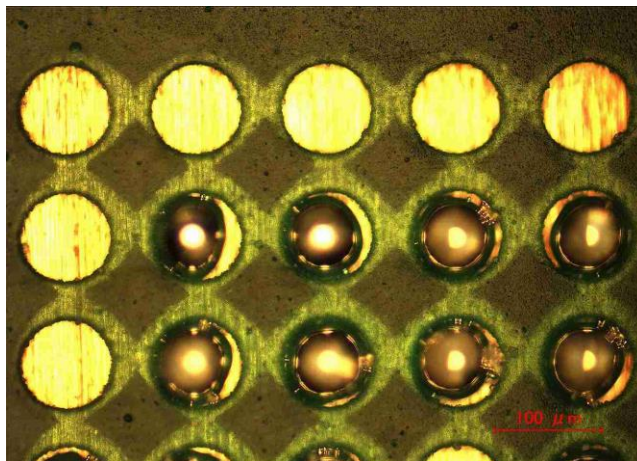
未処理

OSP処理

洗浄前

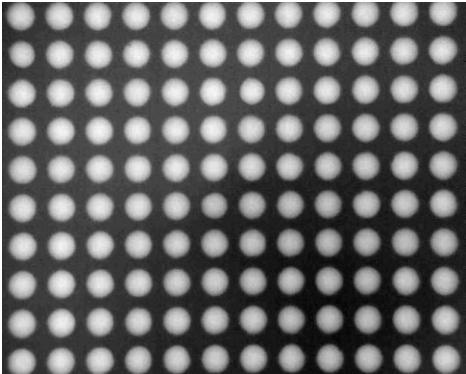
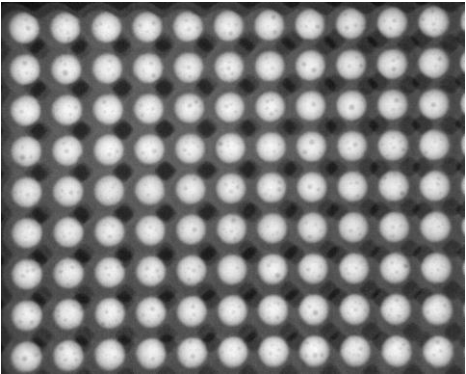
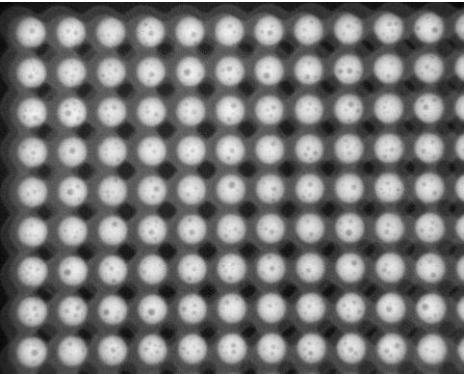
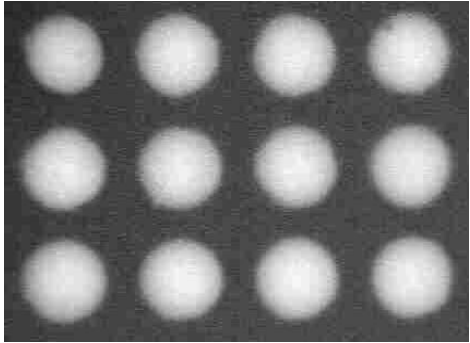
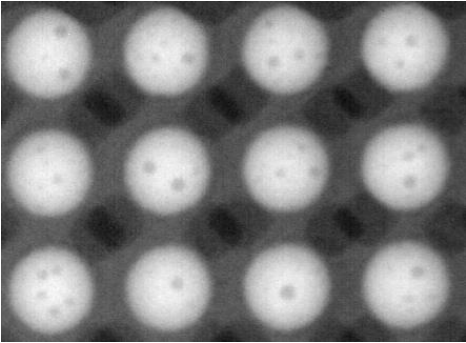
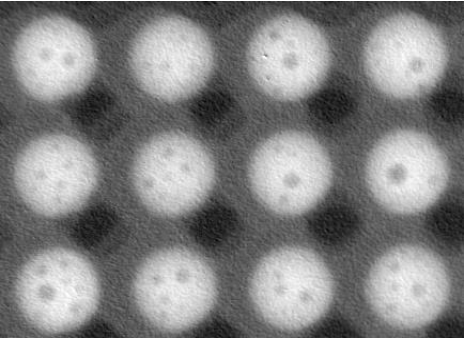


洗浄後



未処理基板では、はんだ未着のためフラックス洗浄時にはんだボールが落ちる

ボイド発生状態のX線写真

Sn電解 (ボイド率:0~0.6%)	Ni/Au処理 (ボイド率:4.5~6.0%)	OSP処理 (ボイド率:6.7~8.4%)
		
		

断面観察

OSP(剥離率:4.5~6.0%)



Ni/Au(剥離率:3.2~4.5%)



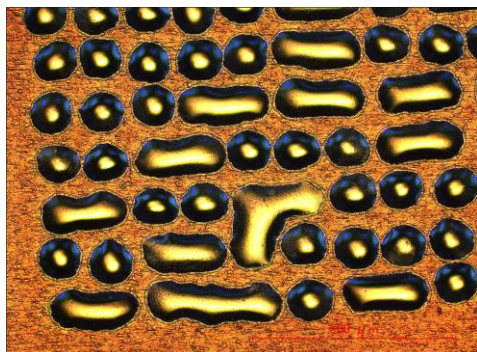
Sn(剥離率:0~0.6%)



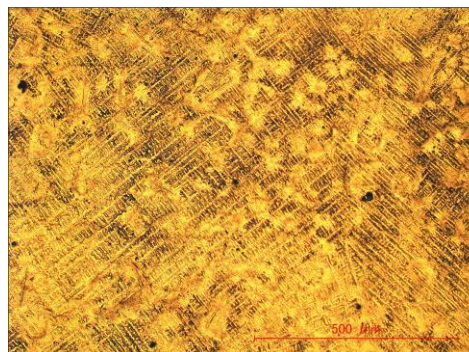
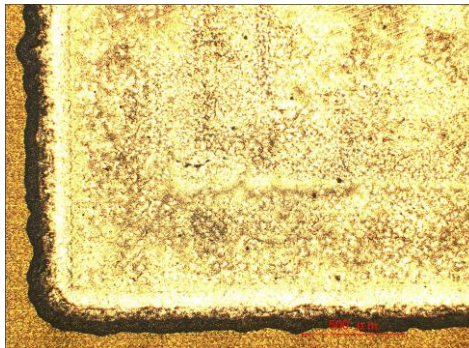
3. 考察とまとめ

ベタ基板でのリフロー後外観

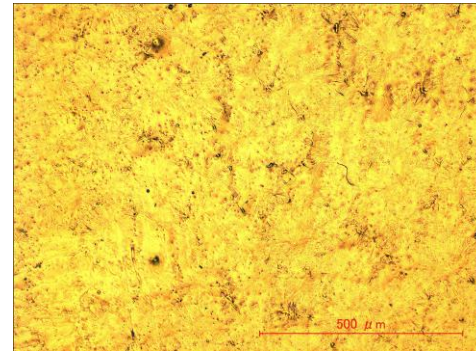
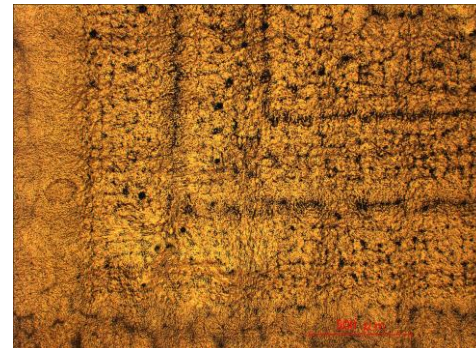
Cu(エッチング)



Ni/Au



Sn

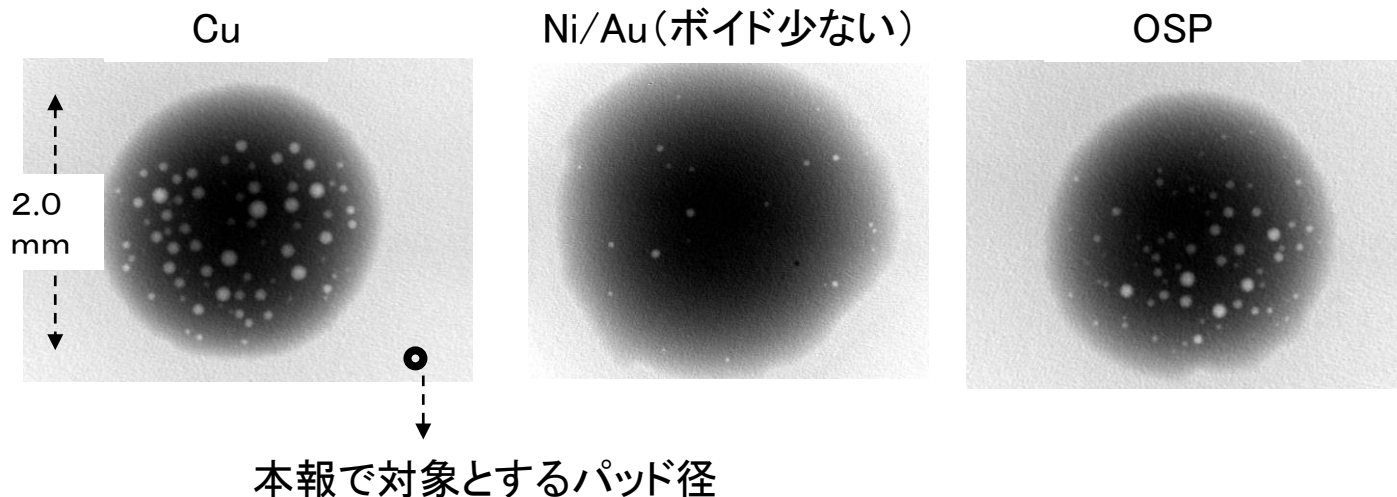


- ・Cu: はんだ広がりが悪く、所々で印刷形状が残る
- ・Ni/Au, Sn: 広がりが良く全面にはんだが流れる

考察

広がりがあるSn処理と同様に優れるNiAuでボイド程度に差があったのは？

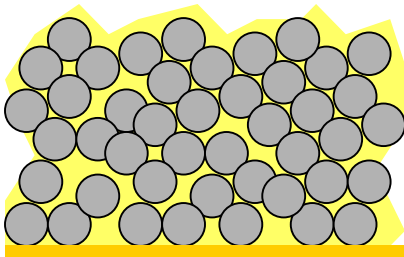
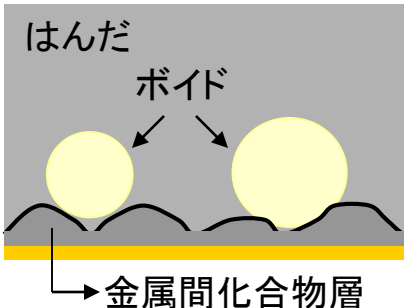
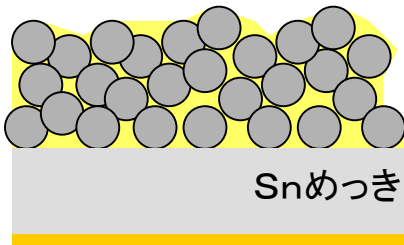
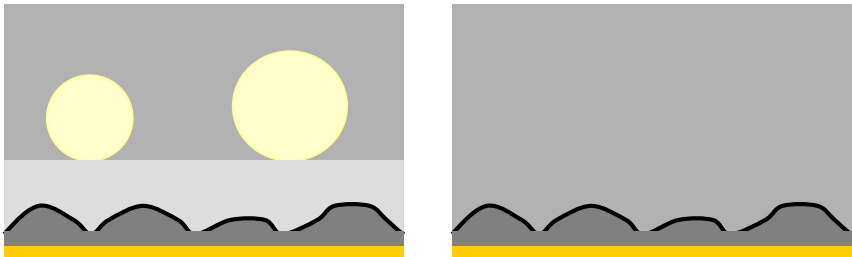
Cuと比較しNi/Auのボイドが少ないX線像



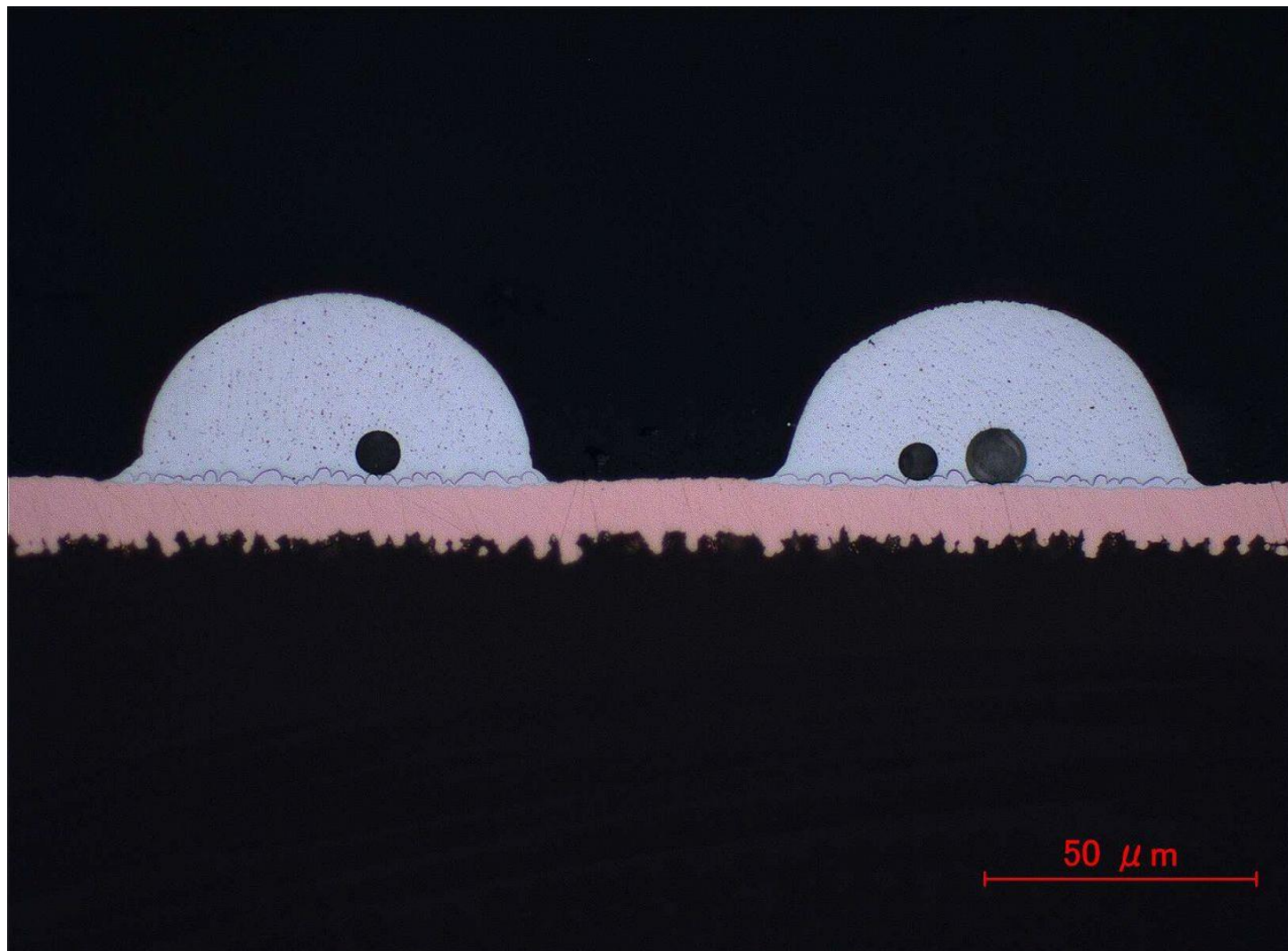
- ・通常の実装条件とは異なること。(微小粉ペースト, N_2 リフロー, 印刷厚 $30\mu m$)
- ・ランドが小さく上記写真では問題にならないボイドを対象としている。

→ 本報ではNi/Auの有効性が得られなかったと推察

Sn処理によるボイドレス理由の推察

ランド表面	ペースト印刷	リフロー
・Cu ・Ni/Au		
Sn		 Snの拡散によりボイドもはんだ中へ！

ボイド部の断面観察(拡大)



まとめ

1. OSP処理基板で2～10%のボイド率を計測した。

材料選択, 各種条件の最適化により、ボイド率を2%程度まで低減できる可能性がある。

2. ランドにSnめっき処理を施すことで、微小ボイドも見られないボイドレス状態が得られた。

クオルテック
「受託研究」ページ

クオルテック
「お問い合わせ」